

(a)



圖 4.12 600℃基材溫度下,以鐵觸媒初成長之奈米結構 SEM 形貌:(a)觸媒
 聚集狀,(b)邊緣觸媒膜厚不均匀處成長之外觀,(c)為(b)圖 c 區之放
 大圖(試片編號分別為 F7 和 F6)



圖 4.13 以不同觸媒材料薄片為基材,初成長 CNTs 後在基材界面之 SIMS 分析結果: (a)鐵, (b)鈷 和(c)鎳薄片基材



(a)



(c)

圖 4.14 在 650℃温度且不同鐵觸媒之厚度下,初成長 CNTs 之 SEM 形貌比

較: (a) 10, (b) 15 和(c) 20 nm 厚度

(試片編號分別為G14,H14 和 I14)



圖 4.15 不同碳源和觸媒條件下,初成長之 CNTs TEM 結構圖 (a)CH<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>=20/2, (b)CH<sub>4</sub>/NH<sub>3</sub>=20/2, (c) 和(d)C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>=5/15 sccm/sccm(試片編號分別為 B6, A11 和 A2)





 圖 4.16 以錄觸媒在相同比例(20/2 sccm/ sccm)不同載入氣體初成長之 CNTs TEM 結構圖(a)CH<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>, (b) CH<sub>4</sub>/CO<sub>2</sub> 和(c)CH<sub>4</sub>/NH<sub>3</sub> (試片編號分別為 A5, A8 和 A11)



圖 4.17 以兩種雷射激發光源(λ=632.8, 514.5 nm)量測初成長之 CNTs 拉曼

頻譜結果比較 (試片編號 E11)



圖 4.18 以不同成長氣氛相同比例 10:1 初成長 CNTs 之拉曼頻譜圖之比較 (a)鈷觸媒 和(b)鎳觸媒



圖 4.19 觸媒厚度對初成長 CNTs 拉曼頻譜之 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>比的影響:

(a)鈷觸媒 和(b)鎳觸媒



(c)

X-軸反應氣體比例:1表示CH4:H2=20:2,2表示CH4:H2=11:11,3表示CH4:H2=2:20,4表示CH4:CO2=20:2,5表示CH4:CO2=11:11,6表示CH4:CO2=2:20,7表示CH4:NH3=20:2,8表示CH4:NH3=11:11,9表示CH4:NH3=2:20(以上單位sccm:sccm)
圖 4.20 在不同的鈷和鎳觸媒厚度下,初成長的CNTs 拉曼頻譜之 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>比與原料氣體比例之關係,(a) 5,(b) 10和(c)15 nm 觸媒厚度







圖 4.21 本研究條件下,最佳之場效發射性質初成長之 CNTs(CH<sub>4</sub>/CO<sub>2</sub>=20/2 sccm/ sccm), (a) SEM 形貌 (b) J-E 曲線圖 (試片編號 A15)



(a)





圖 4.22 以ITO 玻璃與初成長 CNTs 基板形成之兩極場效發光測試前後 CNTs 之 SEM 形貌變化圖, (a) 測試前側視圖, (b) 測試後 CNTs 無發光且未 掉落區俯視圖, (c) 和(d)測試後發光區 CNTs 脫落底材之外觀 (試片編號 E16)